

MPI TS200-IFE | IceFreeEnvironment™付 200 mmマニュアル・プローブシステム

-60℃までプローブカードおよびマイクロポジショナの同時使用が可能です

顕微鏡マウントおよび移動機構

- 剛性の高い顕微鏡ブリッジ (保持機構)
- 50×50 mm XYリニア機構
- リニアリフト (構成変更が容易に)

DCおよびRFポジショナ

- 最大RF 4台またはDC 8台まで搭載可能
- さまざまなマイクロポジショナより選定可能
- 測定用途に合わせて、同軸、トライアキシャル、ケルビン、RFアームのラインアップ

プローブ・プラテン

- 1 mmスケールで、プラテン高を最大20 mmまで調整可能
- DC/CV、RF およびハイパワー測定が可能
- RFポジショナ用角型調整器
- エアークーリング内蔵プラテンで熱安定設計

RFキャリブレーション

- 校正基板用2つの補助チャック
- 高精度な校正のためのセラミック材質
- 平坦度1 μm (高コンタクト精度)

独自のプラテンリフト

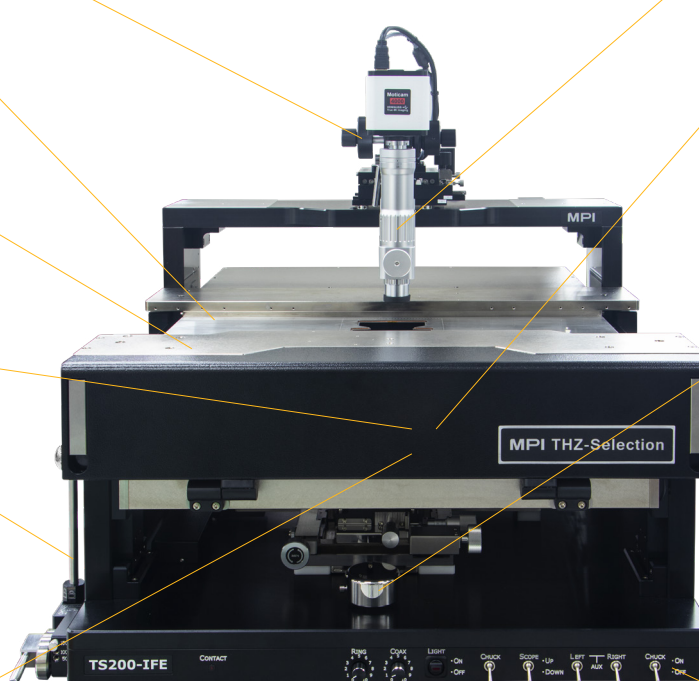
- コンタクト、コンタクト・セパレーション (300 μm)、ロード (3 mm) の3つの独立したポジショニング
- ローディング位置での安全ロック機能
- セーフティー・ロック機能±1 μmの再現性をもつ高コンタクト精度「オート・コンタクト」
- 50、100 または 150 μm アライメント高でのストップ

IceFreeEnvironment™

- マイナスの温度においてもプローブカードおよびマイクロポジショナの同時使用が可能です
- 広い前面ドアよりIC/ウエハの出し入れ
- 環境チャンバによるマイナス温度チャックの使用可能
- 氷結防止のための前面ドアの自動ロック

THZ-選択オプション

- ミリ波、THZ用システムに容易に変更可能
- MPI THZ選択により、TS200-THZ用に設計した画期的な周波数エクステンダー機構を組込むことが可能。周波数エクステンダーを200 mmウエハ面上部で動作可能
- DUTとの距離を最小化することにより、測定の際の方向性と精度を改善



顕微鏡および顕微鏡オプション

- シングルチューブ型顕微鏡 MPI SZ12、MZ12
- 最大12倍ズーム、101 mm 作動距離
- パソコンいらずのHDMI接続差端子付きCCDカメラ

モジュール式チャック

- さまざまな常温、温度チャック
- 300℃までの各種温度範囲より選定可能
- フィールドにてアップグレード可能
- トライアキシャル/同軸チャックより選定
- センター (小さな被測定物)、小ウエハとの切替が簡単
- タッチスクリーンによる完全制御
- チャンバのパーキングにはチャック冷却で使用したCDAを再利用

チャック XY/θステージ機構

- エア・ベアリング・ステージにより片手で簡単にXYポジショニング
- 225 x 260 mm XYステージ移動範囲
- マイクロメータによる25 x 25 mm XY 微調整
- < 1.0 μm 精度 @ 500 μm/解像度
- チャックの360°シート回転、±5° 微調
- 安全コンタクト機能によるコンタクト時のXYロック
- 20 mm空気圧リフトによるウエハのロード/アンロード
- 5 mm高精細Z軸精度 (< 1.0 μm @ 500 μm/解像度)
- ロードが簡単な広いY軸設計
- オプションにより、XまたはY軸の独立ロック機構

真空制御を前面に設置

- 使い易い位置およびはっきりした マーキング
- チャック・ゾーンおよび補助チャック
- ベンチトップ用振動防止アブソーバ台
- 使い易さを追求した薄型設計

オプション

- 防振台
- デュアル・モニタシステム
- 真空ポンプおよびコンプレッサ
- 計測器用棚
- デュアル・モニタスタンド